

CLS-700 T

加圧サンプリングシステム



CLS-700 T 加圧サンプリングシステムは、気泡を含む液体サンプル*を加圧し、気泡を溶解してから微粒子の測定を行う装置です。加圧サンプラーと LiQuilaz® II Sシリーズ液中パーティクルカウンターを一体化したシステムで、超音波洗浄後の洗浄水や発泡性薬液の微粒子測定に適しています。液体サンプル中の気泡を溶解するため、有効な測定結果が得られます。(*圧力容器の液体サンプルには対応しません。)

洗浄装置に組み込むことができ、システムの始動と停止、槽交換時の自動遮断を洗浄装置で制御して、泡や空気がパーティクルカウンターに侵入するのを防ぎます。

CLS-700 T 加圧サンプリングシステムは、プロセス用薬液の微粒子測定に関する SEMI C1規格に完全に準拠しています。



利点

コスト削減

- 50または80 mL/minの流量と100%の全量測定でプロセス認定に要する時間を短縮
- リアルタイムの定性分析で、異常に即座に対応して無駄を削減

多用途

- 広範な用途と液体に対応
- プログラム可能な粒径しきい値
- 機動性を重視した設計
- 加圧サンプリングにより発泡性を含むほとんどの薬液を測定可能
- 外部トリガーによりプロセスイベントに合わせてサンプリングを調整
- 槽から直接測定可能

使いやすい

- Facility Net モニタリングソフトウェアに用意された英数字ページング、センサステータス、表やSPCチャート、時間プロットなどの機能で、オンラインサンプリングを単純化
- SamplerSight バッチサンプリングソフトウェアのデータの保存、取り出し、レポート生成などの高度な機能で、データ管理をあらゆる面から効率化
- 別の液体に変える際にすばやく洗浄できる設計

用途

- 発泡性液体の微粒子レベルを測定
- ウェットプロセスの監視
- 化学薬品の工程管理
- 槽の監視

CLS-700 T

加圧サンプリングシステム

仕様

	CLS-700 T		
ビュレット容積	65 mL標準		
評価容積	48 mL標準		
最大圧縮圧力	120 °Cで60 psi以下、150 °Cで最大45 psi		
外装表面	ポリプロピレン(難燃性仕様FM4910に適合)		
接液面材質	サファイア、Kalrez® 4079、Teflon®、Kel-F®		
サンプル温度	45 psi以下で10~150 °C (60 psiで最高120 °C)、硫酸の場合は最高100 °C		
偽計数	1個/mL未満		
寸法(奥行き、幅、高さ)	16 x 10 x 16インチ (41 x 26 x 39 cm)		
重量	34 lb (15.5 kg)		
通信	RS-232またはRS-485		
使用環境	温度: 10~35 °C、湿度: 結露なし		
ソフトウェア	SamplerSight、Facility Net		
サンプリング	外部トリガーによる制御オプションあり		
設備要件	電源: センサーの要件を参照。ガス圧力: 70~150 psi。液体接続: Flaretek® 1/4インチ。		
	LiQuilaz II S02	LiQuilaz II S03	LiQuilaz II S05
測定粒径	0.2~2.0 µm	0.3~3.0 µm	0.5~20.0 µm
チャンネル数	15	15	15
流量 (ml/min)	50 mL/min ± 10%	80 mL/min ± 10%	80 mL/min ± 10%
サンプリング量	50 mL/min (100%)	80 mL/min (100%)	80 mL/min (100%)
最大可測粒子濃度*	10,000 個/mL	10,000 個/mL	10,000 個/mL
サンプル温度	10~150 °C (45 psi以下で最高150 °C、60 psiで最高120 °C)、硫酸の場合は最高100 °C		
最大圧力	100 psi	100 psi	100 psi
接液面材質	サファイア、Teflon®、Kel-F®、Kalrez®4079		
レーザー源	レーザーダイオード	レーザーダイオード	レーザーダイオード
寸法(奥行き、幅、高さ)	13 x 4 x 5インチ(32 x 11 x 11 cm)、CLS-700 Tの内部		
重量	6 lb (2.7 kg)	6 lb (2.7 kg)	6 lb (2.7 kg)
電源	85-132 V または 220-240 V、50/60 Hz	85-250 V、50/60 Hz	85-250 V、50/60 Hz
通信	RS-485	RS-485	RS-485
キャリブレーション	使用素材は、米国標準技術局(NIST: National Institute of Standards and Technology)および日本工業規格(JIS: Japanese Institute of Standards)に準拠したトレーサビリティを有します。		

*最大可測粒子濃度における計数損失は10%未満。

記載されている仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
LiQuilaz®はParticle Measuring Systems, Inc.の登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
U. S. Patent no. 4,728,190
© 2010 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.



PMS日本支社 (スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F

Tel: 044 589 3498 Fax: 044 245 5000 Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)

Tel: 044 589 3418 Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com